

マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和5年9月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

番号	共用機器種別	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
			学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
				非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-201	イオン注入装置	未登録	2,400	7,400	9,400	2,400	5,200	6,900	2,400	3,400	4,900
	日新電機社製 NH-20SR-WMH	登録		5,200	6,600		3,700	4,900		2,400	3,500
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,200	11,700	---	6,500	8,600	---	4,300	6,200
NU-202	急速加熱処理装置	未登録	1,800	6,700	7,900	1,800	4,500	5,400	1,800	2,700	3,400
	AG Associates社製 Heatpulse610	登録		4,700	5,600		3,200	3,800		1,900	2,400
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,700	10,100	---	6,000	7,000	---	3,800	4,600
NU-203	薄膜X線回折装置	未登録	1,600	6,500	8,000	1,600	4,300	5,500	1,600	2,500	3,500
	RIGAKU社製 ATX-G	登録		4,600	5,600		3,100	3,900		1,800	2,500
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,300	10,100	---	5,600	7,000	---	3,400	4,600
NU-204	原子間力顕微鏡	未登録	1,000	5,700	6,800	1,000	3,500	4,300	1,000	1,700	2,300
	Bruker社製 AXS Dimension3100	登録		4,000	4,800		2,500	3,100		1,200	1,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,900	9,500	---	5,200	6,400	---	3,000	4,000
NU-205	3元マグネトロンスパッタ装置	未登録	1,500	6,300	7,700	1,500	4,100	5,200	1,500	2,300	3,200
	島津製作所製 HSR-522	登録		4,500	5,400		2,900	3,700		1,700	2,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,700	10,500	---	6,000	7,400	---	3,800	5,000
NU-206	電子線露光装置	未登録	3,700	8,800	11,500	3,700	6,600	9,000	3,700	4,800	7,000
	日本電子社製 JBX6300FS	登録		6,200	8,100		4,700	6,300		3,400	4,900
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	13,500	17,100	---	10,800	14,000	---	8,600	11,600
NU-207	X線光電子分光装置	未登録	2,300	7,300	8,900	2,300	5,100	6,400	2,300	3,300	4,400
	VG社製 ESCALAB250	登録		5,200	6,300		3,600	4,500		2,400	3,100
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	10,200	12,300	---	7,500	9,200	---	5,300	6,800
NU-208	マスクアライナー 式	未登録	2,500	7,700	9,200	2,500	5,500	6,700	2,500	3,700	4,700
	(1)Suss MicroTec AG製 MA-6	登録		5,400	6,500		3,900	4,700		2,600	3,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	10,500	12,400	---	7,800	9,300	---	5,600	6,900
NU-209	ICPエッチング装置一式	未登録	10,600	16,900	19,700	10,600	14,700	17,200	10,600	12,900	15,200
	サムコ製 RIE-800	登録		11,900	13,800		10,300	12,100		9,100	10,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	26,500	30,500	---	23,800	27,400	---	21,600	25,000
NU-210	ダイシングソー装置	未登録	2,800	7,800	9,100	2,800	5,600	6,600	2,800	3,800	4,600
	サムコ製 DAD522	登録		5,500	6,400		4,000	4,700		2,700	3,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,100	12,900	---	8,400	9,800	---	6,200	7,400
NU-211	フェムト秒レーザー加工分析システム	未登録	3,800	9,000	11,200	3,800	6,800	8,700	3,800	5,000	6,700
	UFL-Hybrid	登録		6,300	7,900		4,800	6,100		3,500	4,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,000	13,600	---	8,300	10,500	---	6,100	8,100
NU-212	走査型電子顕微鏡	未登録	1,200	6,000	7,300	1,200	3,800	4,800	1,200	2,000	2,800
	日本電子社製 JSM-6301F	登録		4,200	5,200		2,700	3,400		1,400	2,000
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,300	8,900	---	4,600	5,800	---	2,400	3,400
NU-213	8元マグネトロンスパッタ装置	未登録	1,600	6,500	8,000	1,600	4,300	5,500	1,600	2,500	3,500
		登録		4,600	5,600		3,100	3,900		1,800	2,500
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,900	9,700	---	5,200	6,600	---	3,000	4,200
NU-214	8元MBE装置	未登録	2,400	7,500	9,100	2,400	5,300	6,600	2,400	3,500	4,600
		登録		5,300	6,400		3,800	4,700		2,500	3,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,200	11,100	---	6,500	8,000	---	4,300	5,600
NU-215	ECR-SIMSエッチング装置	未登録	1,000	5,800	7,300	1,000	3,600	4,800	1,000	1,800	2,800
		登録		4,100	5,200		2,600	3,400		1,300	2,000
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,100	8,900	---	4,400	5,800	---	2,200	3,400
NU-216	スプレーコーター 式	未登録	1,800	6,900	8,000	1,800	4,700	5,500	1,800	2,900	3,500
	サンメイ製 DC110	登録		4,900	5,600		3,300	3,900		2,100	2,500
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,400	9,700	---	5,700	6,600	---	3,500	4,200
NU-217	リアクティブイオンエッチング装置	未登録	4,300	9,700	11,400	4,300	7,500	8,900	4,300	5,700	6,900
	サムコ製 RIE-10N	登録		6,800	8,000		5,300	6,300		4,000	4,900
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,800	13,800	---	9,100	10,700	---	6,900	8,300

マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和5年9月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

番号	共用機器種別	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
			学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
				非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-218	電気炉 光洋リンドバーグ社製 MODEL272-2	未登録	2,300	7,300	8,700	2,300	5,100	6,200	2,300	3,300	4,200
		登録		5,200	6,100		3,600	4,400		2,400	3,000
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	8,900	10,600	---	6,200	7,500	---	4,000	5,100	
NU-219	酸化・拡散炉 光洋リンドバーグ社製 MODEL270-M100	未登録	1,700	6,900	8,600	1,700	4,700	6,100	1,700	2,900	4,100
		登録		4,900	6,100		3,300	4,300		2,100	2,900
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	8,400	10,500	---	5,700	7,400	---	3,500	5,000	
NU-220	小型微細形状測定機一式 小坂研究所製 ET200	未登録	1,700	6,800	7,800	1,700	4,600	5,300	1,700	2,800	3,300
		登録		4,800	5,500		3,300	3,800		2,000	2,400
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	8,300	9,500	---	5,600	6,400	---	3,400	4,000	
NU-221	プラズマCVD装置 サムコ製 PD-240	未登録	1,600	6,500	8,000	1,600	4,300	5,500	1,600	2,500	3,500
		登録		4,600	5,600		3,100	3,900		1,800	2,500
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	7,900	9,700	---	5,200	6,600	---	3,000	4,200	
NU-222	レーザー描画装置 Heidelberg Instruments社製 DWL66FS	未登録	1,500	6,200	7,600	1,500	4,000	5,100	1,500	2,200	3,100
		登録		4,400	5,400		2,800	3,600		1,600	2,200
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	8,200	9,900	---	5,500	6,800	---	3,300	4,400	
NU-223	フォトリソグラフィ装置 ウソ電機社製 マルチイML251A/B、共和 理研社製 スピンナーK-359SD-1	未登録	1,100	5,900	7,300	1,100	3,700	4,800	1,100	1,900	2,800
		登録		4,200	5,200		2,600	3,400		1,400	2,000
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	7,500	9,200	---	4,800	6,100	---	2,600	3,700	
NU-224	電子ビーム蒸着装置 アルバック社製 EBX-10D	未登録	1,500	6,200	7,500	1,500	4,000	5,000	1,500	2,200	3,000
		登録		4,400	5,300		2,800	3,500		1,600	2,100
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	7,900	9,500	---	5,200	6,400	---	3,000	4,000	
NU-225	ICPエッチング装置 アルバック社製 CE-300I	未登録	2,100	7,000	8,400	2,100	4,800	5,900	2,100	3,000	3,900
		登録	(25,600)	(80,300)	(94,100)	(25,600)	(55,700)	(66,300)	(25,600)	(36,100)	(44,100)
	()内は1回あたりの料金 ※試料を高真空中に保持し作製(約8時間)する場合		4,900	5,900		3,400	4,200		2,100	2,800	
(オプション)研究成果非公開使用料	---	9,300	11,100	---	6,600	8,000	---	4,400	5,600		
()内は1回あたりの料金 ※試料を高真空中に保持し作製(約8時間)する場合		(105,400)	(122,400)	---	(75,700)	(88,900)	---	(51,900)	(62,000)		
NU-226	RIEエッチング装置 サムコ社製 RIE-10NR	未登録	1,300	6,000	7,000	1,300	3,800	4,500	1,300	2,000	2,500
		登録		4,200	4,900		2,700	3,200		1,400	1,800
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	7,900	9,200	---	5,200	6,100	---	3,000	3,700	
NU-227	走査型電子顕微鏡 日立ハイテクフィールドینگ社製 S5200	未登録	1,800	6,600	8,100	1,800	4,400	5,600	1,800	2,600	3,600
		登録		4,700	5,700		3,100	4,000		1,900	2,600
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	9,000	10,900	---	6,300	7,800	---	4,100	5,400	
NU-228	走査型電子顕微鏡 日立ハイテクフィールドینگ社製 S4300	未登録	2,000	6,900	8,200	2,000	4,700	5,700	2,000	2,900	3,700
		登録		4,900	5,800		3,300	4,000		2,100	2,600
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	8,400	10,000	---	5,700	6,900	---	3,500	4,500	
NU-229	スパッタ絶縁膜作製装置 MESアティ社製 AFTEX-3420	未登録	1,500	6,300	7,600	1,500	4,100	5,100	1,500	2,300	3,100
		登録		4,500	5,400		2,900	3,600		1,700	2,200
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	7,700	9,200	---	5,000	6,100	---	2,800	3,700	
NU-231	マスキング露光装置 ナノシステムソリューションズ製 DL-1000	未登録	1,600	6,700	8,000	1,600	4,500	5,500	1,600	2,700	3,500
		登録		4,700	5,600		3,200	3,900		1,900	2,500
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	8,200	9,700	---	5,500	6,600	---	3,300	4,200	
NU-232	原子層堆積装置 サムコ製 AD-100LE	未登録	4,100	9,500	11,300	4,100	7,300	8,800	4,100	5,500	6,800
		登録		6,700	8,000		5,200	6,200		3,900	4,800
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	11,600	13,700	---	8,900	10,600	---	6,700	8,200	
NU-233	蛍光りん光分光光度計 堀場製作所製 Fluoromax-4P	未登録	200	5,200	6,100	200	3,000	3,600	200	1,200	1,600
		登録		3,700	4,300		2,100	2,600		900	1,200
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	6,400	7,400	---	3,700	4,300	---	1,500	1,900	
NU-234	ICPエッチング装置 サムコ社製 RIE-200iPN	未登録	2,900	8,000	9,600	2,900	5,800	7,100	2,900	4,000	5,100
		登録		5,600	6,800		4,100	5,000		2,800	3,600
	(オプション)研究成果非公開使用料	---	9,800	11,700	---	7,100	8,600	---	4,900	6,200	

マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和5年9月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

番号	共用機器種別	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
			学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
				非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-235	超高密度大気圧プラズマ装置 富士機械製造(株)社製	未登録	700	5,400	6,300	700	3,200	3,800	700	1,400	1,800
		登録		3,800	4,500		2,300	2,700		1,000	1,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,100	8,200	---	4,400	5,100	---	2,200	2,700
NU-236	In-situ 電子スピン共鳴(ESR) Bruker社製 EMX Premium X	未登録	2,000	6,900	8,000	2,000	4,700	5,500	2,000	2,900	3,500
		登録		4,900	5,600		3,300	3,900		2,100	2,500
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,200	10,500	---	6,500	7,400	---	4,300	5,000
NU-237	ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置	未登録	1,800	6,600	8,000	1,800	4,400	5,500	1,800	2,600	3,500
		登録		4,700	5,600		3,100	3,900		1,900	2,500
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,400	11,300	---	6,700	8,200	---	4,500	5,800
NU-238	高温プロセス用誘導結合型プラズマエッチング装置 NUシステム製 NU-RC/Cl-Etch	未登録	2,800	7,800	9,100	2,800	5,600	6,600	2,800	3,800	4,600
		登録		5,500	6,400		4,000	4,700		2,700	3,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,200	13,000	---	8,500	9,900	---	6,300	7,500
NU-239	表面解析プラズマビーム装置 NUシステム製 LIA-Plasma Beam/CF&Cl System	未登録	3,700	8,800	11,700	3,700	6,600	9,200	3,700	4,800	7,200
		登録		6,200	8,200		4,700	6,500		3,400	5,100
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	13,900	17,800	---	11,200	14,700	---	9,000	12,300
NU-240	in-situプラズマ照射表面分析装置	未登録	2,900	7,900	9,900	2,900	5,700	7,400	2,900	3,900	5,400
		登録		5,600	7,000		4,000	5,200		2,800	3,800
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	12,400	15,100	---	9,700	12,000	---	7,500	9,600
NU-241	超高密度液中プラズマ装置 NUシステム社製	未登録	1,100	5,900	6,700	1,100	3,700	4,200	1,100	1,900	2,200
		登録		4,200	4,700		2,600	3,000		1,400	1,600
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,200	8,200	---	4,500	5,100	---	2,300	2,700
NU-242	大気圧IAMS(イオン附着質量分析器) キャノンヘルバ社製	未登録	1,800	6,700	7,700	1,800	4,500	5,200	1,800	2,700	3,200
		登録		4,700	5,400		3,200	3,700		1,900	2,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,200	9,400	---	5,500	6,300	---	3,300	3,900
NU-243	真空紫外吸収分光計(原子ラジカルモニター) NUシステム社製	未登録	2,900	7,900	9,100	2,900	5,700	6,600	2,900	3,900	4,600
		登録		5,600	6,400		4,000	4,700		2,800	3,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,600	11,100	---	6,900	8,000	---	4,700	5,600
NU-244	レーザ描画装置一式 Heidelberg製 mPG101-UV	未登録	3,100	8,300	9,700	3,100	6,100	7,200	3,100	4,300	5,200
		登録		5,900	6,800		4,300	5,100		3,100	3,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,900	13,800	---	9,200	10,700	---	7,000	8,300
NU-245	スパッタリング装置一式 キャノンヘルバ製 E-200S	未登録	4,000	9,300	10,900	4,000	7,100	8,400	4,000	5,300	6,400
		登録		6,600	7,700		5,000	5,900		3,800	4,500
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	13,600	15,800	---	10,900	12,700	---	8,700	10,300
NU-246(1)	3次元レーザ・リソグラフィシステム一式 (1)Nanoscribe製 フォトリソグラフィシステム	未登録	2,600	7,700	9,300	2,600	5,500	6,800	2,600	3,700	4,800
		登録		5,400	6,600		3,900	4,800		2,600	3,400
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	10,700	13,000	---	8,000	9,900	---	5,800	7,500
NU-246(2)	3次元レーザ・リソグラフィシステム一式 (2)KISCO製 SCLEAD3CD2000	未登録	700	5,500	6,500	700	3,300	4,000	700	1,500	2,000
		登録		3,900	4,600		2,400	2,800		1,100	1,400
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,100	8,400	---	4,400	5,300	---	2,200	2,900
NU-247	ナノインプリント装置一式 SCIVAX製 X-300 BVU-ND	未登録	1,700	6,900	8,300	1,700	4,700	5,800	1,700	2,900	3,800
		登録		4,900	5,900		3,300	4,100		2,100	2,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,900	10,700	---	6,200	7,600	---	4,000	5,200
NU-248	パリレンコーティング装置一式 KISCO製 DACS-LAB	未登録	400	5,300	6,300	400	3,100	3,800	400	1,300	1,800
		登録		3,800	4,500		2,200	2,700		1,000	1,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	6,500	7,700	---	3,800	4,600	---	1,600	2,200
NU-249	高精度電子線描画装置一式 日本電子機製 SPG-724	未登録	5,300	11,000	12,800	5,300	8,800	10,300	5,300	7,000	8,300
		登録		7,700	9,000		6,200	7,300		4,900	5,900
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	13,400	15,500	---	10,700	12,400	---	8,500	10,000
NU-250	マスクライナー一式 (2)Suss MicroTec AG製 MJB-3	未登録	1,200	6,400	7,500	1,200	4,200	5,000	1,200	2,400	3,000
		登録		4,500	5,300		3,000	3,500		1,700	2,100
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,800	9,100	---	5,100	6,000	---	2,900	3,600

マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和5年9月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

番号	共用機器種別	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
			学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
				非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-251	マスクアライナー式	未登録	1,100	6,300	7,400	1,100	4,100	4,900	1,100	2,300	2,900
	(3)ナノテック製 LA410	登録		4,500	5,200		2,900	3,500		1,700	2,100
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,700	9,000	---	5,000	5,900	---	2,800	3,500
NU-252	蛍光バイオイメージング装置一式	未登録	1,100	5,900	7,200	1,100	3,700	4,700	1,100	1,900	2,700
	共焦点レーザー顕微鏡システム ニコン製 A1Rsi-N	登録		4,200	5,100		2,600	3,300		1,400	1,900
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,200	8,800	---	4,500	5,700	---	2,300	3,300
NU-253	SEM用断面試料作製装置	未登録	700	5,700	6,500	700	3,500	4,000	700	1,700	2,000
	JEOL製 SM-09010	登録		4,000	4,600		2,500	2,800		1,200	1,400
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,000	7,900	---	4,300	4,800	---	2,100	2,400
NU-254	デジタルマイクロスコープ式	未登録	1,000	5,900	6,900	1,000	3,700	4,400	1,000	1,900	2,400
	KEYENCE製 VK-9700	登録		4,200	4,900		2,600	3,100		1,400	1,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,200	8,400	---	4,500	5,300	---	2,300	2,900
NU-255	デジタルマイクロスコープ式	未登録	800	5,500	6,400	800	3,300	3,900	800	1,500	1,900
	KEYENCE製 VK-9510	登録		3,900	4,500		2,400	2,800		1,100	1,400
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	6,700	7,800	---	4,000	4,700	---	1,800	2,300
NU-256	Deep Si Etcher	未登録	8,800	14,900	17,700	8,800	12,700	15,200	8,800	10,900	13,200
	住友精密工業製 Multiplex-ASE	登録		10,500	12,400		8,900	10,700		7,700	9,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	18,100	21,500	---	15,400	18,400	---	13,200	16,000
NU-257	露光プロセス装置一式	未登録	700	5,500	6,600	700	3,300	4,100	700	1,500	2,100
	ユニオン光学社製 PEM800	登録		3,900	4,700		2,400	2,900		1,100	1,500
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	6,700	8,000	---	4,000	4,900	---	1,800	2,500
NU-258	フーリエ変換赤外分光分析装置	未登録	1,100	5,900	7,100	1,100	3,700	4,600	1,100	1,900	2,600
	日本分光社製 FT/IR-615V型	登録		4,200	5,000		2,600	3,300		1,400	1,900
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,200	8,600	---	4,500	5,500	---	2,300	3,100
NU-259(1)	磁気特性評価システム	未登録	1,200	6,000	7,100	1,200	3,800	4,600	1,200	2,000	2,600
	(1)交番磁界勾配型磁力計	登録		4,200	5,000		2,700	3,300		1,400	1,900
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,300	8,600	---	4,600	5,500	---	2,400	3,100
NU-259(2)	磁気特性評価システム	未登録	900	5,700	6,800	900	3,500	4,300	900	1,700	2,300
	(2)振動試料型磁力計	登録		4,000	4,800		2,500	3,100		1,200	1,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,000	8,300	---	4,300	5,200	---	2,100	2,800
NU-259(3)	磁気特性評価システム	未登録	1,000	5,800	6,800	1,000	3,600	4,300	1,000	1,800	2,300
	(3)トルク磁力計	登録		4,100	4,800		2,600	3,100		1,300	1,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,100	8,300	---	4,400	5,200	---	2,200	2,800
NU-259(4)	磁気特性評価システム	未登録	1,100	5,900	7,100	1,100	3,700	4,600	1,100	1,900	2,600
	(4)磁気光学スペクトロメータ	登録		4,200	5,000		2,600	3,300		1,400	1,900
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,200	8,600	---	4,500	5,500	---	2,300	3,100
NU-260	マスクレス露光装置	未登録	1,300	6,300	7,200	1,300	4,000	4,700	1,300	2,200	2,700
	ネオアーク製 PALET DDB-701-DL4	登録		4,500	5,100		2,800	3,300		1,600	1,900
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,600	8,800	---	4,900	5,700	---	2,700	3,300
NU-261	段差計	未登録	1,000	5,900	6,800	1,000	3,600	4,300	1,000	1,800	2,300
	小坂研究所製 ET200A	登録		4,200	4,800		2,600	3,100		1,300	1,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,100	8,300	---	4,400	5,200	---	2,200	2,800

★研究成果非公開使用料は、共用機器1時間あたりのオプション料金であり、別途加算する。

☆上記共用機器使用料は、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」の採択により軽減されております。事業終了後は、通常の料金設定となります。

II 算出内訳 別紙1のとおり

III 項目別算出基礎 別紙2のとおり

IV 解析手数料(1時間当たり)

単位:円、消費税込み

解析手数料	学内者	学外者	
		非営利法人	営利法人
		5,900	6,600

V 算出基礎 別紙3のとおり